

イオンミリング装置 ArBlade® 5000

Ion Milling System ArBlade® 5000

電子顕微鏡の試料前処理用イオンミリング装置の最上位機種として，“ArBlade 5000”を発売しました。SEMの高性能化や従来の機械研磨では困難な前処理ニーズに応え、日立のイオンミリング装置の出荷台数は1,100台を超えました。

“ArBlade 5000”は、当社製品比で約2倍のミリングレートを有する高レートArイオンガン(PLUS IIイオンガン)を搭載し、長時間処理が必要な試料に対して断面イオンミリングの処理時間を大幅に短縮しました。また、タッチパネルによるオペレーションによって自動スタート機能等、操作性も向上しました。さらに、エレクトロニクス分野からのニーズに応えるため、断面ミリングの広領域化を図ったミリングホルダを開発しました。これによりエレクトロニクス分野に限らず、セラミックスや金属などの硬質材料においても高スループットで広領域の断面試料作製が可能です。

主な特長

- (1) 新型高レートミリングイオンガン(断面ミリングレート: 1 mm / hr 以上)
- (2) スライドミリングホルダにより加工幅: 8 mm に対応。
- (3) 液晶タッチパネルの採用により操作系を一新。
- (4) 断面ミリングと平面ミリングに対応したハイブリットミリング装置。

* ArBlade® は、日本国内における株式会社 日立ハイテクノロジーズの登録商標です。



図1 イオンミリング装置 ArBlade 5000 の外観